

权利要求书

1、一种晶圆清洗干燥装置，其特征在于，包括：

用于对晶圆（8）进行清洗的箱体（1），所述箱体（1）的顶部设有用于供晶圆（8）进、出所述箱体（1）的开口；

设于所述箱体（1）内且用于承接晶圆（8）的支撑机构（2），所述支撑机构（2）可升降；

设于所述开口处且用于对清洗后的晶圆（8）表面喷洒干燥气体的喷淋管（3）。

2、根据权利要求1所述的晶圆清洗干燥装置，其特征在于，所述喷淋管（3）的数量为两个，两个所述喷淋管（3）错开设置，以分别对晶圆（8）的前后两面喷洒所述干燥气体。

3、根据权利要求1所述的晶圆清洗干燥装置，其特征在于，所述箱体（1）外设有直线驱动机构，所述直线驱动机构的输出端设有第一磁铁，所述支撑机构（2）固设有第二磁铁，所述第一磁铁与所述第二磁铁异极相吸，以当所述直线驱动机构输出往复运动时，使所述第二磁铁带动所述支撑机构（2）同步升降。

4、根据权利要求3所述的晶圆清洗干燥装置，其特征在于，所述箱体（1）内固设有用于对所述支撑机构（2）的升降进行导向的导向柱或导向槽。

5、根据权利要求1-4任一项所述的晶圆清洗干燥装置，其特征在于，所述支撑机构（2）包括：

第一滑块（21），所述第一滑块（21）设有用于与晶圆（8）的侧面相抵触的顶针（211）；

第二滑块（22），所述第二滑块（22）设有用于卡住晶圆（8）的卡槽。

6、根据权利要求5所述的晶圆清洗干燥装置，其特征在于，还包括用于当晶圆（8）伸出所述开口时卡住晶圆（8）的上方的卡爪（4）。

7、根据权利要求6所述的晶圆清洗干燥装置，其特征在于，所述箱体（1）的顶部设有可转动的导轨（5），所述卡爪（4）可滑动的设于所述导轨（5）。

8、根据权利要求7所述的晶圆清洗干燥装置，其特征在于，还包括用于当晶圆（8）完全干燥后卡住晶圆（8）的下方的托架（6），所述托架（6）可伸缩。

9、根据权利要求8所述的晶圆清洗干燥装置，其特征在于，所述箱体（1）的顶部设有翻转机构（7），所述导轨（5）与所述翻转机构（7）的输出端相连，所述托架（6）的固定部与所述导轨（5）固定连接。